تأثير التلدين بوساطة الليزر النبضي على E_g لأفلام رقيقة $CuInSe_{\gamma}$ نصف ناقلة من

زكريا ظلام' ، ناصر سعد الدين'، خالد عقيل' ١: جامعة البعث ، حمص ، سورية ٢: جامعة دمشق ، دمشق ، سورية بريد الكتروني : zzalam@baath.shern.net

يهدف هذا البحث إلى معالجة افلام رقيقة من CuInSe المستخدمة كطبقات ماصة في الخلايا الشمسية. رسبت أفلام رقيقة متماثلة من نصف الناقل CuInSer على شرائح زجاجية بطريقة التبخير الومضي تحت ضغط منخفض أفلام رقيقة متماثلة من نصف الناقل CuInSer على شرائح زجاجية بطريقة التبخير الومضي تحت ضغط منخفض قدره 0 ميلي بار. لدنت الطبقة السطحية بوساطة ليزر نبضي من نوع NAC-YAG الماقة النبضة ٢,٥ ميلي جول وكانت استطاعة التلدين كالتالي (0 , 0 , 0 , 0 ميلي بار. لدنت الطبقة السطحية بوساطة ليزر نبضي من نوع QAG-YAG المادنة وغير المادنة بوساطة مقياس الطيف التلدين كالتالي (0 , 0 , 0 , 0 , 0 ميلي بار. لدنت الطبقة السطحية بوساطة ليزر نبضي من نوع QAG-YAG المادنة وغير المادنة بوساطة مقياس الطيف الضوئي كالتالي (0 , 0 ,

كلمات دالة : فلم رقيق ، تلدين ، المجال المحظور ، النفوذية الضؤئية.

أظهرت الدراسات المختلفة التي أجريت على الطبقات الرقيقة إمكانية استخدام هذه الطبقات في تصنيع الخلايا الشمسية. وتأتي أهمية استخدامها في صناعة الخلايا الشمسية نظراً لانخفاض كلفة إنتاج الواط الساعي. يوجد العديد من المركبات المستخدمة لتصنيع خلايا شمسية من الطبقات الرقيقة منها مركبات المجموعات -II IV كخلايا كبريت الكادميوم[١] ومركبات المجموعات II-III-VI كالخلايا المعتمدة على CuInSe₂ و CuInS₂].يلعب عرض المجال المحظور لهذه المواد دوراً أساسياً في اختيارها كطبقات ماصة في الخلايا الشمسية ذوات الوصلات غير المتجانسة (heterojunction)[٣-٤]، حيث تترواح قيمته مابين و ٢.(-٩, ١, ٥) وهي نقع ضمن المجال المفضل للطبقات الماصة في الخلايا الشمسية في الخلايا الشمسية في المعتمدة علي ع

انصب خلال العقد الأخير من القرن الماضي اهتجاف المتحاف المناصف في المحاف المناسبة [•]. النصب خلال العقد الأخير من القرن الماضي اهتمام الباحثين على استخدام تقانات تلدين بوساطة الليررات العينات أو لتعديل أشكال حفر الكمون فيها ، وقد نشر مؤخراً أنه تم استخدام الحزمة الليزرية لتلدين الشبكات العملاقة دون أي تخريب للطبقات داخل البنية . يستخدم الليزر ذو الطاقة المنخفضة [LPLA] حالياً في إعادة توزيع الشوائب في العينات وفي التلدين السطحي للطبقات الرقيقة (٥٠٢).

تعتمد معالجة المواد بوساطة الليزرعلى الدفقات الحرارية المكثفة التي تعطيها الحزمة الليزرية للتأثير على عمق صغير جداً من السطح فتصهره دون التغلغل إلى داخل المادة . فعندما تسلط الحزمة الليزرية على سطح المواد المراد معالجتها، فإن جزءاً من هذه الحزمة ينعكس عن السطح وينفذ الجزء الباقي إلى عمق يتعلق بطاقة الحزمة. تلعب حالة السطح دوراً هاماً في فعالية امتصاص الأشعة الليزرية من قبل المادة. ويزداد المردود الطاقي لعمليات المعالجة الحرارية بزيادة خشونة السطح ولهذا يفضل عند إجراء المعالجة السطحية للسطوح الملساء جعلها خشنة بغية رفع فعالية امتصاصها للأشعة الليزرية .

تتميز الطبقات الرقيقة المُرسبة في الخلاء وبوجود بعض العيوب البلورية في بنيتها ، تلعب عملية التلدين دوراً هاماً في خفض نسبة هذه العيوب مما يؤدي إلى تغير المقاومة الكهربائية . لهذا يطبق حالياً التلدين على نطاق واسع على المواد المستعملة في الصناعة الإلكترونية.

<u>٢ - أهمية البحث:</u>

من المعلوم أن استخدام الخلايا الشمسية لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة الكهربائية يعاني من انخفاض مردود هذا التحويل بسبب عدد من العوامل أهمها [٨]: - ضياع جزء من الطاقة الشمسية في الشبكة المعدنية الموجودة في الجبهة الأمامية للخلية الشمسية وتبلغ حوالي ١٠% . ٢-تمتص الطبقة المانعة الانعكاس جزء من الطاقة الشمسية تبلغ نسبته حوالي ١٠% ٢-تمتص الطبقة المانعة الانعكاس جزء من الطاقة الشمسية تبلغ نسبته حوالي ١٠% ٣-ضياع جزء من طاقة الأشعة تحت الحمراء الموجودة في الأشعة الشمسية التي تبلغ نسبته حوالي ٢٠% ٢-تمتص الطبقة وتبلغ حوالي ٢٠% ٢-تمياع جزء من الطاقة الشمسية نتيجة وجود أشعة شمسية طاقة فوتوناتها لا تتوافق مع المجال المحظور ٢ -ضياع جزء من الطاقة الشمسية ما يسبته حوالي ٢٠% ٢ منياع مزء من الطاقة الشمسية ما يسبته حوالي ٢٠% ٢ منياع مزء من الطاقة الشمسية ما نسبته حوالي ٢٠% وهو الجزء القابل للتحويل إلى طاقة كهربائية. يقع مردود الخلايا الشمسية المستخدمة حاليا ما بين ٢٥ وهو الجزء القابل للتحويل إلى طاقة كهربائية. في صناعتها، لذلك تسعى جميع الأبحاث التي تجري حاليا لزيادة مردود الخلايا إلى أعلى نسبة ممكنة. ما أنه لايمكن التحكم بالأجزاء الضائعة من طاقة الأسسية فإن الأبحاث تتركز على تحضير مواد لها مع أنه لايمكن التحكم بالأجزاء الضائعة من طاقة الأشمسية فإن الأبحاث تتركز على تحضير مواد لها مع ما أنه لايمكن التحكم بالأجزاء الضائعة من طاقة الأشعة الشمسية فإن الأبحاث تتركز على تحضير مواد لها أكثر ملائمة لزيادة نسبة الطاقة المحل التي تحري حاليا لمجتيزة ما ما مع الأبحاث تتركز على تحضير مواد لها ولي مائمة لزيادة نسبة معام على التحكم بطاقة المصلية المحظور للمواد المستخدمة بحيات يصبح

يستخدم المركب CuInSe₂ في صناعة الخلايا الشمسية المعتمدة على الطبقات الرقيقة التي تمتاز بانخف اض كلفتها [٤]. لقد قمنا في هذا البحث بدراسة التأثيرات الناتجة عن المعالجة السطحية بوساطة الليزرعلى قيم طاقة المجـــال المحظور Eg لطبقات رقيقة لمركب CuInSe التي أدت إلى خفض طاقة المجال المحظور ، مما يؤدي إلى زيادة مردود الخلايا الشمسية المعتمدة على الطبقات الرقيقة للمركب الأنف الذكر.

٣-الأجهزة المستخدمة:

١-جهاز تبخير (إنتاج فرنسي) يعتمد طريقة التبخير الومضي.
٢-جهاز مقياس الطيف الفوتوني(spectrophotometer) نوع V-530 من إنتاج شركة JASCOW .
٣-جهاز ليزري نبضي من نوع Nd-YAG المعدل (Q-switchet) وطول موجته m 1.06μ استطاعته الوسطى 40W ، وطاقة النبضة الليزرية Z.5mJ . مزود بجهاز قياس من النوع (Thermopile) لقياس الستطاعة المتطاعة الدفقات الليزرية.

٤- القسم العملي:

1-4-تحضير العينات:

تم تحضير عدد كبير من الطبقات الرقيقة المتماثلة والمتجانسة سماكتها 0.6μm من مادة CuInSe₂ بطريقة التبخير الومضي. وذلك تحت ضغط منخفض يساوي ⁶⁻¹⁰ ميلي بار . وتم اختيار عدد كاف من العينات المتجانسة والمتماثلة وذلك من خلال الحصول على طيوف نفوذية متماثلة باستخدام مقياس الطيف الفوتوني.

أخضعنا بعض العينات إلى دفقات ليزرية مختلفة الاستطاعة حيث تم تخفيض الاستطاعة الأساسـية لليـزر بوساطة مضعف (attenuator) وكان معدل تكرار النبضات ٥٠٠ Hz. يبين الجدول (١) استطاعة الحـزم الليزرية المستخدمة لتلدين الطبقات الرقيقة .

الجدول رقم(١) ويبين استطاعة الحزم الليزرية المستخدمة لتلدين الطبقات الرقيقة .

رقم العينة	استطاعة الشعاع الليزريw	
S1(شاهد)	-	
S2	0.17	
S3	0.60	
S4	0.80	

2-4- أطياف النفوذية:

تم بوساطة مقياس الطيف الفوتوني(spectrophotometer) تحديد أطياف النفوذية T للطبقة غير الملدنة وللطبقات الملدنة باستطاعات مختلفة و هي موضحة في الشكل رقم (۱)



الشكل رقم(١) أطياف النفوذية للطبقات المدروسة .

يمثل المنحني (1−a) طيف النفوذية للطبقة غير الملدنة بينما تمثل المنحنيات (1−d)،(1−) أطياف النفوذية للطبقات الملدنة بالدفقات الليزرية ذوات الاستطاعات w (1,--,,10,--,10) على الترتيب. نلاحظ من الشكل (1) -[يمقارنة المنحنيات (1-d)،(1-c)،(1-b) مع المنحني (1-a)] - أن أكبر تغير في شدة طيف النفوذية كان للمنحنى (1-b) أي للعينة التي خضعت لمعالجة بدفقات ليزرية ذات الاستطاعة الأكبر. يفسر ذلك بأن الحزمة الليزرية ذات الاستطاعة الأكبر اخترقت الطبقات الليزرية في عمق أكبر أل عام إعادة بلورة طبقة سميكة من الطبقة المعالجة. أما الحزمة الليزرية ذات الاستطاعة على عمق صغير فقط ، ونستدل على ذلك من التشابه الكبير بين شكل طيف النفوذية الطبقة المادنية بالاستطاعة (0.17w) وشكل طيف النفوذية للطبقة غير الملدنة واختلاف الطيفين الأخرين عنه.

3-4۔ تحدید معاملات الامتصاص:

اعتماداً على أطياف النفوذية –الشكل (۱)– حسبنا الامتصاصية (Α (λ ومعامل الامتصــاص (α(λ) وذلــك باستخدام العلاقتين التاليتين [۹]:

$$A(\lambda) = \log \frac{1}{T} \dots (1)$$

$$\alpha(\lambda) = 2.303 \frac{A(\lambda)}{d} \dots (1)$$

حيث d: سماكة العينة

نظراً لعدم حاجتنا لعرض أطياف الامتصاصية (λ) A-وهي مماثلة لأطياف(λ) α من حيث الشكل –فاننا نكتفي بعرض تغيرات قيم معاملات الامتصاص بدلالة طاقة الفوتون لكل من الطبقة غير الملدنة والطبقـات الملدنة باستطاعات مختلفة . انظر الشكل (٢) .



الشكل (٢) أطياف معاملات الامتصاص للطبقات المدروسة ا

نلاحظ من الشكل (٢) أن قيم معاملات الامتصاص للطبقات الملدنة قد ازدادت عن مثيلاتها للطبقة غير الملدنة من أجل جميع الأطوال الموجية ، ونلاحظ أيضاً أن قيم معاملات الامتصاص تزداد بزيادة استطاعة الحزمة الليزرية المستخدمة بعملية التلدين.

4-4-حساب طاقة المجال المحظور المباشرEg:

لحساب طاقة المجال المحظور المباشر Eg للطبقات المدروسة استخدمنا علاقة [Pankov] التالية:[١١،١٠]

$$\alpha = \frac{A_s (hv - E_g)^2}{hv} \dots \dots (r)$$

حيث :A_s ثابت

يبين الشكل (a-b-c-d-۳) المنحنيات البيانية لتغيرات المقدار α.hv) للطبقات المدروسة بدلالة تغير طاقة الفوتونات الضوئية .



الشكل (٣) منحنيات تغير المقدار ²(α.hv) بدلالة تغير طاقة الفوتون

يمثل الشكل (α-۳) منحني تغيرات المقدار (α.hv) بدلالة تغير طاقة الفوتون للطبقة غير الملدنة ، بينما تمثل الأشكال (b, c, d-3) المنحنيات المماثلة للطبقات الملدنة بالاستطاعات w (b, c, d-3) على الترتيب. للحصول على قيم المجال المحظور المباشر مددنا الجزء الخطي من المنحنيات الواردة في الشكل (٣) حتى نقطة تقاطعه مع محور طاقة الفوتون ، وبذلك حصلنا على قيم Eg لمختلف الطبقات المدروسة[11] ودوناها في الجدول رقم (٢).

٤-٥-حساب طاقة المجال المحظور غير المباشر:E_{gi}

لحساب طاقة المجال المحظور غير المباشر للطبقات المدروسة استخدمنا علاقة [Pankov] التالية المحال المحظور غير $B_{s}(hv - E_{gi})^{2}$ $\alpha = \frac{1}{hv}$

حيث :B_s ثابت



يبين الشكل(a, b, c, d-٤) المنحنيات البيانية لتغيرات المقدار (α. hv) للطبقات المدروسة بدلالة تغير طاقة الفوتون.

الشكل (٤) منحنيات تغير المقدار (۵. hv) بدلالة تغير طاقة الفوتون

يمثل الشكل ($a-\epsilon$) منحني تغيرات المقدار $(\alpha.hv)^{1/2}$) للطبقة غير الملدنة بدلالة تغير طاقة الفوتون ، بينما تمثل الأشكال (b, c, d-4) منحنيات المماثلة للطبقات الملدنة بالاستطاعات w (0.0-0.6-0.8) على الترتيب.

للحصول على قيم المجال المحظور غير المباشر مددنا الجزء الخطي من المنحنيات الواردة في الشكل (٤) حتى نقطة تقاطعه مع محور طاقة الفوتون [١١]. وقد أوردنا هذه القيم في الجدول رقم (٢).

 E_{gi} الجدول رقم (٢) ويبين قيم طاقة المجال المحظور المباشر E_{g} وطاقة المجال المحظور غير المباشر E_{gi} الطبقات الرقيقة المدروسة.

رقم العينة	استطاعة الشعاع الليزري	طاقة المجال المحظور	طاقة المجال المحظور
	المستخدم في التلدين	$\mathrm{E}_{\mathrm{gi}}(\mathrm{ev})$ غير المباشر	$\mathrm{E}_{\mathrm{g}}(\mathrm{ev})$ المباشر
S 1	0.0 w	1.1 ± 0.01	1.4 ± 0.01
S2	0.17 w	1.00 ± 0.01	1.38 ± 0.01
S3	0.60w	0.9 ± 0.01	1.2 ± 0.01

S4	0.80w	0.95 ± 0.01	1.25 ± 0.01
----	-------	-----------------	-----------------

نلاحظ من الجدول رقم(٢) أن قيم طاقة المجال المحظور المباشر وغير المباشر قد انخفضت نتيجة لعملية التلدين، كما نلاحظ أن أصغر قيمة لكل من طاقتي المجال المحظور المباشر وغير المباشر كانتا الطبقة الملدنة بحزمة ليزرية استطاعتها ٥٠٠٠ مما سبق نستنتج أن التلدين بحزمة ليزرية ذات استطاعة صغيرة لم تؤد إلى تغير يذكر في طاقة المجال المحظور أما زيادة استطاعة الحزمة اليزرية عن ٢٠٠٠ فقد أدى لم تؤد إلى تغير يذكر في طاقة المجال المحظور أما زيادة استطاعة الحزمة اليزرية ذات استطاعة صغيرة الم تؤد إلى تغير يذكر في طاقة المجال المحظور أما زيادة استطاعة الحزمة الليزرية عن ٢٠٠٠ فقد أدى إلى بدء ارتفاع قيمة كل من طاقة المجال المحظور أما زيادة استطاعة الحزمة الليزرية عن ٢٠٠٠ فقد أدى إلى بدء ارتفاع قيمة كل من طاقة المجال المحظور المباشر وغير المباشر مجدداً، ويعود ذلك إلى زيادة عمق الطبقة السطحية من الطبقة الرقيق المتأثرة بعملية التلدين عن الحد المفضل . ومعود ذلك إلى تعير مقارنة قيم Eg التي حصلنا عليها للطبقة غير الملدنة وللطبقات الملدنة مع نتائج دراسات أخرى أجريات برجات حرارة مندانا عليها للطبقة غير الملدنة والطبقات المادنة مع نتائج مع القيق المجال المدخور قالمباشر وغير المباشر مجدداً من يعود ذلك إلى زيادة عمق الطبقة المجال المحظور المباشر وغير المباش مجداً من ويعود ذلك إلى زيادة عمق الحد المفضل .

٥- مناقشة النتائج :

ترد التغيرات في الخصائص الضوئية والكهربائية للطبقات الرقيقة نتيجة لعملية التلدين إلى العوامل التالية: ١- تخفيف الحدود بين الحبيبات المجمعة على سطوح الطبقات الرقيقة . ٢- إعادة بلورة الطبقة السطحية من الطبقات الرقيقة مما يقلل من عيوب البنى البلورية ٣–أدت عملية إعادة البلورة إلى عزل بعض الشوائب غير المرغوب فيها التي يمكن أن تساهم فــي زيــادة عملية إعادة الاتحاد بين الإلكترونات والثقوب المتولدة . من مقارنة طيف النفوذية للطبقة غير الملدنة مع أطياف النفوذية للطبقات الملدنة بحرم ليزرية مختلفة الاستطاعة نلاحظ انخفاض نفوذية الطبقات للأشعة الضوئية بزيادة طاقة الأشعة الليزرية ،من أجــل جميــع الأطوال الموجية ، وهذا يعنى زيادة امتصاص الأشعة الضوئية . تجلت زيادة امتصاصية الطبقات الملدنة للأشعة الضوئية بوضوح من زيــادة قــيم معــاملات الامتصــاص للطبقات الملدنة بالمقارنة مع قيم معامل الامتصاص للطبقة غير الملدنة، من أجل جميع الأطـوال الموجيـة الضوئية ضمن المجال المدروس من nm (١١٠٠–٣٥٠) . أدت عملية التلدين إلى خفض قيم كل من طاقة المجال المحظور المباشر وطاقة المجـــال المحظــور غيــر المباشر وكانت أصغر قيمة لكل منهما للطبقة الملدنة بحزمة ليزرية استطاعتها w ٠,٦ حــين كانــت قــيم معامل الامتصاص – وبالتالي الامتصاصية – للطبقة الملدنة بأشعة ليزرية استطاعتها w ٨,٨ أكبر من القيم المقابلة للطبقة الملدنة بالاستطاعة w ٠,٦ w ويمكن تفسير ذلك بأن التلدين باستطاعة w ٠,٨ أدى إلى صهر وإعادة بلورة سماكة كبيرة من الطبقة الرقيقة مما أدى إلى زيادة الامتصاص غير المفيد للأشعة الضوئية (أي الامتصاص الذي لا يتم عبر المجال المحظور).

مما سبق نلاحظ أن عملية التلدين أدت إلى زيادة قيم معامل الامتصاص كما أدت إلى انخفاض طاقة المجال المحظور للطبقة الرقيقة المحضرة من CuInSe₂ ، لذلك نتوقع زيادة مردود الخلايا الشمسية التي تتكون طبقتها الماصة من هذه الطبقات إذا ما لدنت بشكل مناسب.

٦ - الاستنتاجات :

- أدت عملية التلدين بحزم ليزرية نبضية إلى انخفاض نفوذية (أي زيادة امتصاصية) الطبقات الملدنة للأشعة الضوئية.
- ٢. أدت عملية التلدين إلى خفض قيم طاقة المجال المحظور المباشر E_g وغير المباشر E_{gi} وكانت أخفض قيمة لكل منهما في الطبقة الملدنة بحزمة ليزرية استطاعتها ٠,٦ w

3 .من المتوقع أن يؤدي انخفاض قيمة طاقة المجال المحظور للطبقة الماصة في الخلايا الشمسية إلى المساهمة في تحويل جزء من الأشعة الشمسية التي طاقتها h ν_i تقع ضمن المجال ΔEg و ΔEg إلى طاقة كهربائية ، وهذا يؤدي حتماً إلى زيادة مردود الخلايا الشمسية التي تصنع من طبقات CuInSe₂ الملدنة .

4 . نقترح أن يتم تلدين الطبقات الرقيقة المستخدمة في صناعة الخلايا الشمسية التي تعتمد المركب CuInSe₂ كطبقة ماصة بحزمة ليزرية استطاعتها 0.60w.

- 1- A.Hariri-1996-Indications Towards the Improvement of the Cds-Cu_xS <u>Thin film Solar cells</u>. Aleppo University Journal..No:21.P: 150-160
- Y-M.Bourgoul -1993-<u>these de Doctoral fabricaton et caraeterisation de</u>

<u>couches minces de Cu(Ga,In)Te₂</u> pour evaporation Eclair MontpellierII -France P:36-39

3- J.L. Shay,-1972-Physices.letter.vols:29-17 . P:1162.

- **ξ**-S.Agustinus –**1993** <u>these Fabrication et caracterisation de couches</u> minces de CuInSe₂,CuGa_{0.5} In_{0.5}Te₂ ...Universite Montpeller II-France
- •-A .Catalono-**1996**-<u>Polycrystalline thin films techologes Status and</u> prospects. Solar Energy Materials and solar cell 41/42 P:205-217.
- 7-R.F.Wood,C.W.white –1984-Semiconductors and semimetals Vol:23Pulsed laser Annealing Processing of Semicopnductors Acadmic Press Inc London.
- 7-H.Howari-1999-<u>Pulsed laser Annealing CdTe/Cd_{1-x}Mn_xTe Epilayers</u> <u>and Pulsed Laser Emission of ZnS/Zn_{1-x}Cd_xS</u> Quantum Well Structures.Univ.Hull.P:123
- 8-Hans Joachim Moller -1993-<u>Semiconductors for solar cells</u> ISBN 0- 89006-574-8 P:43.
- 9-Jascow corportion-SpectraAnalysis Program-1996-UV530 P:26.
- 10- J. I. Pankove-**1975-** Optical Process in Semiconductors .Dover New York.P:344
- 11- T.Akuko -1995-growth and physical properties of Vacuum evaporated PbSnS thin films workshop on materials Science and Physics of Non-conventional Energy sources

International Center for Theoretical Physics. Publication Smr/872-12.

12-Zeater Khlil -1999-thies- <u>these de Doctoral fabricaton et caraeterisation de</u> quaternaires pour Ellipsoscpique applaction photovoltaic

Montpellier II – France P:7-20.

تأثير التلدين بوساطة الليزر النبضي على E_g لأفلام رقيقة $CuInSe_{\gamma}$ نصف ناقلة من

زكريا ظلام' ، ناصر سعد الدين'، خالد عقيل' ١: جامعة البعث ، حمص ، سورية ٢: جامعة دمشق ، دمشق ، سورية بريد الكتروني : zzalam@baath.shern.net

يهدف هذا البحث إلى معالجة افلام رقيقة من CuInSe المستخدمة كطبقات ماصة في الخلايا الشمسية. رسبت أفلام رقيقة متماثلة من نصف الناقل CuInSer على شرائح زجاجية بطريقة التبخير الومضي تحت ضغط منخفض قدره $^{-0}$ ميلي بار. لدنت الطبقة السطحية بوساطة ليزر نبضي من نوع NAC-YAG الماقة النبضة ٢,٥ ميلي جول وكانت استطاعة التلدين كالتالي CuInSer، على شرائح زجاجية بطريقة الضوئية للافلام الملدنة وغير الملدنة بوساطة وكانت استطاعة التلدين كالتالي ($^{-0}$, الماحية بوساطة ليزر نبضي من نوع A(كالحاقة النبضة ٢,٥ ميلي جول مقياس الطيف الضوئي كالتالي ($^{-0}$, الماحة بوساطة ليزر نبضي من نوع A(كال الملدنة وغير الملدنة بوساطة مقياس الطيف الضوئي (Spectrophotometer) على طيف النفوذية حددنا الامتصاصية ($^{-0}$) وحسبنا باستخدام علاقتي [$^{-0}$ علية المجال المحظور المباشر Eg وغير المباشر Eg . بعد المناقشة توصلنا الى لاستتاجات التالية: أدت عملية التلدين بحزم ليزرية نبضية إلى انخفاض النفوذية الضوئية، أدت عملية التلدين إلى المحظور المباشر Eg وغير المباشر الفوذية الضوئية، أدت عملية التلدين بول المحظور المباشر Eg وغير المباشر الفوذية الضوئية، أدت عملية التلدين بول المحظور المباشر Eg وغير المباشر الفوذية الضوئية، أدت عملية التلدين بحزم ليزرية نبضية إلى انخفاض النفوذية الضوئية، أدت عملية التلدين إلى المحظور المباشر Eg وغير المباشر الفوذية الضوئية، أدت عملية التلدين إلى المحظور المباشر Eg وغير المباشر الفوذية الضوئية، أدت عملية التلدين بول المباشر وE وغير المباشر Eg وغير المباشر الفوذية الضوئية، أدت عملية التلدين إلى الماصة في النفوذية الموئية، أدت عملية التلدين بولي الماصة وغير المباشر الفوذية الموئية، أدت عملية التلدين الى الماصة وغير المباشر الفوزية المالية الفوذية الموئية، أدت عملية المالين المو الفوذية المولي الفوذية الموئية، أدت عملية الملولين المالية الفوذية الموئية، أدت عملية التلدين إلى الاستتاجات التالية: أدت عملية التلدين بولي المولية المالية الفوذية الموئية، أدت عملية المالين المول الموئية، أدت عملية المولي المولي الموئية، أدوى المولي الفول الفوذية الموئية المولي المولي المولي المولي المول المولية المولي المولي

كلمات دالة : فلم رقيق ، تلدين ، المجال المحظور ، النفوذية الضؤئية.

The Effect of Annealing by Laser Pulses on Eg for Semi-Conductor Thin Films of CuInSe₂

Zakaria Zalam¹, Naser Saad Aldin¹, Khalid Aqel²

¹:Al-Baath University, P.O. Box 77 Homs, Syria ²:Damascus University, Damascus, Syria Email: zzalam@baath.shern.net

The aim of this research is the treatment of absorption layer of the solar cells for increasing their efficiency. Thin films of CuInSe₂ are considered important semiconductors and are used as an absorption layer in the solar cells. Thin films of homogeneous CuInSe₂ of 0.6 λ m thickness were prepared by flash evaporation on glass slides under low pressure of 10^{-6} mbar. The surface layer of some of the films were annealed by laser pulses with the power of 2.5 mJ (milli Joules) using Nd-YAG pulsed laser (0.17-0.6-0.8) w. The optical transmittance of these films were measurd in the range of 190-1100 nm. The absorption coefficients A (λ)were calculated before and after annealing and then the energy gaps were estimated using Pankove relationships. Decrease in the direct and indirect energy gap values were observed because of annealing, It was concluded from the obtained results: The annealing process by pulsed laser led to the decreased transmission and consequently it resulted in an increase of the absorption of the solar rays, The annealing process decreased values of the direct and indirect energy gaps Eg and Egi and therefore the lowest value was for the thin films which were annealed by laser with 0.6 w, The decrease in the values of the energy gaps of the absorbed layer of the solar cells contributed in the conversion of solar beams of $h\lambda_I$ energy within the fields λ Eg and λ Egi to electrical energy. This led to the increase in the efficiency of solar cells that are produced from the annealing films of CuInSe₂. We therefore suggest annealing the thin films used in the manufacture of solar cells that use CuInSe₂ as absorbing layer for laser beams of 0.60 w.

Key words: Thin films, Solar cells, Annealing, Energy gap, Opti